

СОЛВЕР НЕКСТ. Сканирующий зондовый микроскоп, НТ-МДТ, Россия



Год выпуска

2011

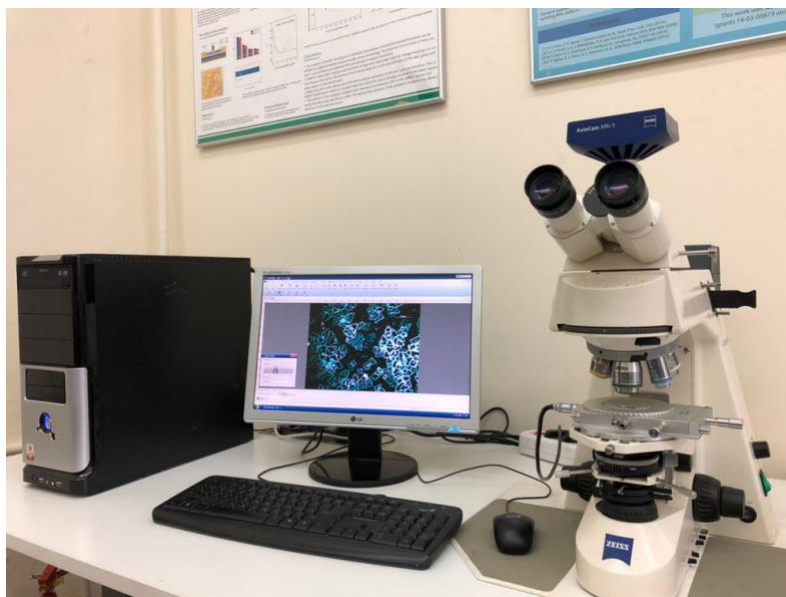
Назначение

Исследование морфологии поверхности тонких плёнок при помощи основных методик атомно-силовой микроскопии. Топография, отображение фазы, измерение электрических характеристик, возможность нанолитографии и др.

Технические характеристики

Измерительные головки:	АСМ и СТМ (стационарные, с автоматической установкой); жидкостная (сменная, с ручной установкой)
Размер образца:	до 20 мм в диаметре, до 10 мм в высоту
Вес образца:	до 100 г
Тип сканирования:	образцом
Область сканирования:	100x100x10 мкм (с датчиками обратной связи), 3x3x2 мкм в режиме высокого разрешения
Нелинейность, XY:	0.1 % (с датчиками обратной связи)
Шум XY:	не более 0.3 нм (с датчиками обратной связи)
Уровень шума Z (RMS в полосе 10 — 1000 Гц):	0.03 нм (типично) с датчиками обратной связи, 0.02 нм в режиме высокого разрешения

Поляризационно-оптический микроскоп Axioscop 40 A Pol, Carl Zeiss, Германия



Год выпуска

2009

Назначение

Предназначен для материаловедения, медицинских, геологических и минералогических лабораторий, обучения и повседневной работы. Используется для исследования керамики, композиционных и строительных материалов; для исследования материалов: тонкие пластинки скал, пленки, волокна, биокристаллы и пигменты.

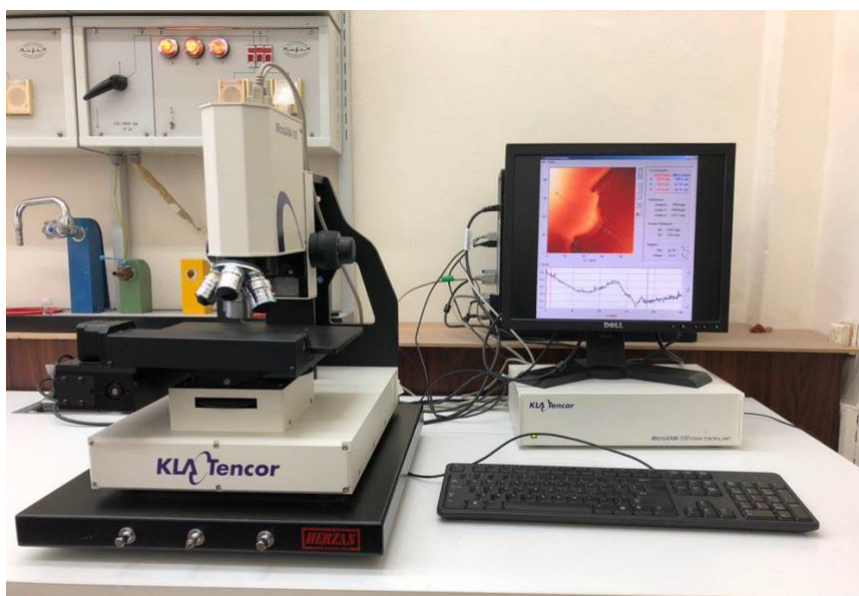
Методы исследования: светлое и темное поле, фазовый контраст, VARIO - контраст, поляризованный свет.

Технические характеристики

Методы контрастирования: проходящий свет: Pol, H, D, Ph; отраженный свет: Pol, H, D, DIC, C/DIC, FI.

Бинокулярные и тринокулярные насадки (тип Siedentopf), фототубус Pol, эрготубус. Термоприставка Linkam

Оптический профилометр MicroXAM-100, KLA-Tencor, США



Год выпуска

2012

Назначение

Предназначен для бесконтактного профилирования поверхности оптическим методом с белым светом. Прибор объединяет фазосмещающую технологию интерферометра и оптический микроскоп, что позволяет проводить бесконтактные 3D измерения поверхностной шероховатости с субнанометровым разрешением.

Технические характеристики

Воспроизводимость измерения вертикальной ступеньки	1 нм (1 σ)
Погрешность измерений	<0,1%
Вертикальный диапазон сканирования	250 мкм (10 мм опционально)
Скорость вертикального сканирования	До 7,2 мкм/с
Площадь обзора	101x101 мкм – 1,0x1,0 мм